

<i>Гончаров А.А.</i> Характерные особенности формирования структуры, состава и свойств пленок диборидов переходных металлов PVD-методами	4
<i>Андреев А.А., Соболев О.В., Горбань В.Ф., Столбовой В.А., Сердюк И.В.</i> Получение вакуумно-дуговых высокотвердых Mo-N покрытий	15
<i>Pogrebnyak A.D., Jameel N.Y., Mommed G.A-K.M.</i> Affects deposition time and substrate temperature on optical properties of ZnO thin film	21
<i>Долгов А.С., Лорент А.Л.</i> Распределение атомов на поверхности при конденсации моноатомного слоя	25
<i>Швец О.М., Береснев В.М., Турбин П.В., Грудницкий В.В., Немченко У.С., Колесников Д.А.</i> Применение импульсного ВЧ генератора с ударным контуром в методе вакуумно-дугового осаждения при синтезе наноструктурированных покрытий	32
<i>Гулямов Г., Шарипбаев Н.Ю.</i> Влияние температуры на ширину запрещенной зоны полупроводника	40
<i>Jabua Z.U., Gigineishvili A.V., Tabatadze I.G., Kupreishvili I.L.</i> Long-term relaxation of photoconductivity in cadmium doped Gd ₂ S ₃ films	44
<i>Балабай Р.М., Чернікова О.М.</i> Пасивація поверхні плівкового кремнію органічними моношарами 1-октадецену: розрахунки із перших принципів	48
<i>Алиев Р., Олимов Л., Мухтаров Э., Алиева Ж.</i> Процесс формовки пластин поликристаллического кремния из порошкового сырья и анализ примесного состава их поверхности	55
<i>Сичікова Я.О.</i> Отримання надграток рор-InP/моно-InP шляхом електрохімічного травління	60
<i>Погребняк А.Д., Махмуд А.М.</i> Кавитационная стойкость покрытий TiN	63
<i>Шамирзаев С.Х., Гулямов Г., Дадамирзаев М.Г., Шарипбаев Н.Ю., Гулямов А.Г.</i> Фазовые портреты деформационных эффектов на тензочувствительных плёнках Bi ₂ Te ₃ и Sb ₂ Te ₃	68
<i>Стыров В.В., Симченко С.В.</i> Поперечная хемомагнитная э.д.с. в фосфиде индия при взаимодействии с атомарным водородом	72
<i>Точилін С.Д.</i> Особливості поширення світла в елементарних напівпровідниках під час лазерної обробки	77
<i>Чернышов Н.Н., Слипченко Н.И., Панченко А.Ю., Лю Чан, Щербак Е.Л., Фурсова Е.В.</i> Анализ влияния магнитного поля на физические процессы в фотоэлектрических преобразователях на основе компьютерной модели	82
<i>Литовченко С.В., Петриченко А.П., Береснев В.М., Куперь И.Г., Витковский Е.А.</i> Поведение композитов молибден-силицидное покрытие при механических и термических нагрузках	87
<i>Правила оформлення рукописей</i>	94
<i>Правила оформлення рукописів</i>	95
<i>Information for authors</i>	96